

第 177 回レーザー協会研究会

— 材料表面の品位向上および高機能化へのレーザー光の応用 —

【主旨】製品に対する要求が一段と高度なものとなるのに伴い、生産に関わるすべてのプロセスの高度化が求められています。製品の機能高度化には、材料表面の品位向上と高機能化が常に大きな効果をもたらしてきました。特にレーザー応用プロセスは、そのような材料表面の高品位化に対する効果的な手段として大いに期待されています。そこで、第 177 回レーザー協会研究会は、「材料表面の品位向上および高機能化へのレーザー光の応用」をキーテーマとして、レーザー応用表面処理プロセスの新しい試みをご紹介します。ぜひとも多くの皆様方にご聴講いただき、活発で有意義な研究会といたしたく存じます。

【日時】 2017 年 1 月 19 日(木) 13:00~16:10

【会場】 上智大学 四ツ谷キャンパス 中央図書館 8 階 L-821 室

・所在地: 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1

・会場案内: キャンパスマップ <http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access> をご参照ください。

【内容】

13:00~13:05 開会のあいさつ

13:05~13:45 「フェムト秒レーザーによる3次元加工とそのバイオ応用」

講演者: 理化学研究所 杉岡 幸次 氏

13:50~14:30 「レーザープロセッシングを利用した高機能表面創成」

講演者: 東北大学 水谷 正義 氏

14:30~14:40 休 憩

14:40~15:20 「超短パルスレーザーによる表面微細形状加工プロセスへの取組み」

講演者: サイバーレーザー株式会社 関田 仁志 氏

15:25~16:05 「レーザー照射による単結晶シリコンの欠陥修復と表面性状制御」

講演者: 慶応義塾大学 閻 紀旺 氏

16:05~16:10 総括ならびに閉会のあいさつ

【当日連絡先】 Tel:090-1606-5658 レーザー協会運営委員 坂本治久 (上智大学)。

【参加費】 会員: 無 料 非会員: 4,000 円

【申込締切】 2017 年 1 月 17 日(火)

【申込みおよび問合せ先】 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1

上智大学 理工学部 機能創造理工学科 坂本 治久

E-mail: h-sakamo@sophia.ac.jp TEL&FAX: 03-3238-3405 (直通)

177 回レーザー協会第研究会 参加申込書

下記事項ご記入の上、FAX もしくは E-mail にてお申し込み下さい。

FAX:03-3238-3405 上智大学理工学部機能創造理工学科 精密工学研究室 行

フリガナ	当協会における会員資格:(○で囲んでください)
ご氏名:	賛助会員 個人会員 未加入(未加入でも参加:可)
貴社名:	ご参加人数:
ご連絡先	
ご住所:〒	
TEL: - - , FAX: - -	
E-mail:	